

# 新超精密加工プロセス技術と応用技術の提案

技術指導・企業内教育

装置・部材の販売

好評予約受付中

CMPと洗浄・メッキの研究開発に必須  
“ダイナミック電気化学反応 (d-EC) 装置”

## 革新的高性能デバイスの実現

### Keywords;

- 1) 超精密加工プロセス技術
- 2) CMP(Chemical Mechanical Polishing) 技術
- 3) 難加工材料 (SiC, GaN, ダイヤモンドなど) の加工プロセス技術
- 4) ダイラタンシー現象応用加工技術
- 5) プラズマ融合 CMP(Plasma Fusion CMP) 技術と応用
- 6) HPMJ(High Pressure Micro-Jet) 洗浄とその応用
- 7) 研磨技術史研究
- 8) その他 ウエハ接合, MEMS, ファインバブル水応用,  $MnO_2/Mn_2O_3$  砥粒の応用, チャンバー密閉型光触媒 CMP 装置, etc.

企業へ  
橋渡し

人的ネットワークの紹介

受託加工



# 株式会社 Doi Laboratory

業界初! CMP 技術者・研究者待望 / ハンディタイプの

## 「ダイナミック電気化学評価装置 (d-EC)」

CMP の加工メカニズム解明、スラリー・パッドの開発に必携 / 精密洗浄・メッキ分野の応用研究にも最適

“静的・動的ターフェルプロット”の自動描画 (in-situ)

仕様; (概略寸法 250x200x250 mm)

機械系ユニット; 小型 CMP 機構 (加工圧力・回転数可変) 搭載  
参照電極・対極白金付属セル、XYZ 微調整機構マイクロメータ搭載

電源・制御ユニット; ポテンショスタット、USB インターフェース、PC 制御、  
標準負荷装置内蔵 (メンテナンス補助 / 測定時間短縮・精度確保)

ノイズ防御用シールドカバー, 作用極フレキシブルコンタクト法

代表取締役 土肥 俊郎

福岡システム LSI 開発センター 401  
福岡県福岡市早良区百道浜 3-8-33  
〒814-0001 電話 (092) 986-3507  
<http://www.doilaboratory.com>  
E-mail: toshiro.doi.883@m.kyushu-u.ac.jp

